

2021年12月2日

報道関係者 各位

レーザーテック株式会社
東証第1部コード 6920
横浜市港北区新横浜 2-10-1

代表者名 代表取締役社長 岡林 理
発表担当 経営企画部長 三澤 祐太郎

新製品 コンフォーカル顕微鏡自動検査/レビュー装置 OPTELICS AI²を発表

【概要】

この度レーザーテックは、コンフォーカル顕微鏡自動検査/レビュー装置 OPTELICS AI²を製品化しました。

【内容】

レーザーテックは、高速自動欠陥検査機能、欠陥マッピング機能、高倍率形状レビュー機能を統合した新型コンフォーカル顕微鏡自動検査/レビュー装置 OPTELICS AI²を製品化しました。

半導体デバイス市場では5GやHPC向けをはじめとする需要増大が続いており、半導体デバイス製造工程では継続的な製品開発による性能向上が求められております。新設計、新素材を活用したデバイスの商品化には、試作品の評価、量産時の品質管理、歩留まり向上に向けたプロセス改善等、部門をまたいで多数の課題を解決する必要があります。

「AI²」は自動欠陥検査から欠陥レビュー、三次元形状測定まで一台で対応可能であり、開発から生産に至るまであらゆる場面で活躍いたします。

本装置では当社のコア技術であるコンフォーカル光学系および半導体検査装置の開発で培った自動検査ソフト、さらに新設計の高速動作可能なハードウェアを統合することで、ハイスループットの高速検査機能と、コンフォーカル顕微鏡による高倍率形状測定機能を両立しております。また、Deep Learningを用いたAI検査技術により、高精度な画像分類や、パターン付き基板検査、特定種の欠陥抽出といった高度な検査機能をご提供いたします。

当社では今後も、お客さまのご要望にお応えし、各種開発の促進と生産性の向上に貢献してまいります。

【特長】

- 半導体ウェハの自動欠陥検査から高倍率レビュー、形状測定まで一台で対応。開発から生産までさまざまなシーンで活躍
- 高速検査：サブミクロンの感度で、3 inch ウェハを15分で全面検査可能
- 高倍率レビュー：対物レンズの切り替えにより、高倍率三次元形状測定が可能
- Deep Learningによる高精度な画像分類を実現。パターン付き基板検査や特定欠陥種の検査が可能

- 化合物半導体やフィルムなど、透明サンプルにおいても、裏面反射の影響を受けずに検査、高倍率レビュー、形状測定が可能
- ハードウェアからソフトウェアまでシステム一式をレーザーテックが提供するため、お客さまのご要望に合わせたカスタマイズとシステム全体のサポートが可能

【用途】

- 半導体ウェハの高速自動欠陥検査
- 欠陥レビュー
- 欠陥形状測定
- 各製造工程での欠陥追跡



◇お問い合わせ先◇

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 共焦点システムソリューション部 菊池 航介

TEL : 045-478-7337

E-mail : kosuke.kikuchi@lasertec.co.jp